



Alpelei im Fürstentum Liechtenstein – der Tagungsort des Zerstäubungs-Symposiums
vom 11. bis 13. Oktober 1972

Alpelei in the Principality of Liechtenstein – the Meeting Place of the Sputtering Symposium,
October 11. – 13. 1972



INHALT / CONTENTS

	Seite / Page
Einleitung von Prof. Dr. Dr. h.c. Max Auwärter	5
Vorwort / Preface	6
Richard W. Wilson Methods of Thin Film Deposition	9
Lewis E. Terry Sputtering and its Effects on Semiconductor Devices	23
M. Loiseau, P. Pilleur Vacuum Package Influence on Storage Charges Detected by MOS Measurements in Sputtered Quarz Thin Films	33
Richard W. Wilson, Lewis E. Terry Metallization Systems for Semiconductor Devices	39
Helmut Murrmann Probleme der Metallisierung bei hochintegrierten bipolaren Halbleiterschaltungen	49
R. Gelsing, O. v. Ommeren Multilevel Metallization Systems with Beam Leads	57
Richard W. Wilson Thin Film Resistors	63
Richard W. Wilson Thin Film Depositions Using the SPUTRON	73
Otto A. Sager Production of Conductive, Transparent Films by Reactive Triode Sputtering	83